

2011/8/29

報道資料

国内唯一！“はかる”品質に関わる最新技術が集結！！

測定計測展

Measuring Technology Expo 2011

(旧:光ナノテクフェア)

【出展者や併催企画が決定しました】

日本光学測定機工業会と日本精密測定機器工業会は2011年10月、東京ビッグサイトにて測定をはじめとした計測全般に関する総合展示会「測定計測展 / Measuring Technology Expo 2011」を開催いたします。本展示会は毎年6月に開催されていた「光ナノテクフェア」を大幅にリニューアルし、フジサンケイビジネスアイの特別協力のもとに新たな情報交流の場として生まれ変わります。光学測定・精密測定はもちろん、幅広い計測業界の最新製品・技術・情報が一堂に集まり、関係者にとって見逃せない3日間となります。

また、同時開催展として「センサエキスポジャパン」、「TEST / 総合試験機器展」、「国際セラミックス総合展」が同会場内で行われます。多数の来場者が集まりますので、関係各社様には是非ご取材いただきたく、お願い申し上げます。

日本光学測定機工業会

<http://www.j-oma.jp/>

光学測定機を製造販売しているメーカー団体です。ものづくりに必要不可欠な光学・測定・画像機器の健全な進歩発展により産業界に対し品質の安心・安全に貢献することを目指しています。

〒105-0011 東京都港区芝公園 3-5-8 機械振興会館 204

TEL & FAX 03-3435-8083

日本精密測定機器工業会

<http://www5.ocn.ne.jp/~jma/>

精密測定機器業界が結束し、情報の共有、技術の向上を図り、当該事業の健全な発展を通じて日本経済の繁栄に寄与することを目的としています。

〒105-0003 東京都港区西新橋 3-14-2 榎木ビル 3F

TEL : 03-3434-9557 FAX : 03-3434-1695

【開催概要】

名称：測定計測展 / Measuring Technology Expo 2011

(第46回全日本光学測定機展 / 第15回国際精密測定展) 旧：光ナノテクフェア

会期：2011年10月12日(水) - 14日(金) 10:00 - 17:00

時間：10:00 ~ 17:00

会場：東京ビッグサイト 西ホール

主催：日本光学測定機工業会、日本精密測定機器工業会

特別協力：フジサンケイ ビジネスアイ

後援：経済産業省、(社)応用物理学会

協賛：(社)精密工学会、日本光学会

入場料：1,500円(招待券持参者およびWEB事前登録者は無料)

併催企画：光計測シンポジウム、実務応用セミナー、技術相談コーナー、新技術発表コーナー

【出展対象】

測定・計測および光学・レーザーに関連する製品・技術・サービス・情報など

[出展製品例]

長さ：寸法・距離（ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージ、投影機、測定顕微鏡、
段差・厚さ測定機、顕微干涉計、膜厚計、光走査外寸測定機、レーザー干涉測長計、
電気マイクロメータ、空気マイクロメータ）
位置・座標（2・2.5・3次元座標測定機、画像測定機）
平面・立体形状（真円度測定機、平面度・球面度測定機、断面形状測定機）
表面粗さ測定機

測定基準器：ゲージブロック、ゲージ（ねじゲージ、テーパゲージ、ピンゲージ、隙間ゲージ）、
精密定盤、精密水準器

角度：オートコリメータ、角度測定機

熱・光・電磁放射：温度計、測光・測色・分光計（照度・放射照度、輝度・放射輝度、
光束・放射強度、色彩・色温度）

光学特性：屈折率、偏光、干渉

その他の物理量：歪・応力・欠陥

観察：金属顕微鏡、実体顕微鏡、その他の顕微鏡、その他の観察機器

作業用機器：芯出し顕微鏡・望遠鏡、加工用機器

専用機器：歯車測定機、ねじ測定機、偏心検査器、真直度測定機、自動定寸装置、自動選別機
実験機器、支援機器

部品・ユニット：スケールユニット、測長ユニット、変位測定ユニット、ロータリーエンコーダ、
メカニカルユニット、座標データ処理機器、TV 関連機器、画像関連機器、光源関連機器、
光学ユニット、光学部品

その他

【出展者一覧】（8月29日現在）

(株)アイゼン	(株)小坂研究所	パール光学工業(株)
itp(株)	(株)三啓	パナソニック プロダクションテクノロジー(株)
ekm Jena GbR	(株)システムズエンジニアリング	フォトテクニカ(株)
(株)インデコ	(株)第一測範製作所	(株)藤田製作所
(株)SPI エンジニアリング	中央精機(株)	(株)ベイビッグ
OGP / YKT(株)	(株)テクロック	ヘキサゴン・メトロロジー(株)
(株)尾崎製作所	TESA(株)	ボリュウムグラフィックス(株)
(株)オプトサイエンス	土井精密ラップ(株)	マール・ジャパン(株)
オプトシリウス(株)	(株)東京精密	(株)マグネスケール
(株)オプトロニクス社	(株)トプコン	(株)溝尻光学工業所
(株)オプトン	トリモス・シルバック ジャパン(株)	(株)ミツトヨ
オリンパス(株)	(株)中村製作所	(株)メトロテック
カールツァイス(株)	(株)ニコンインステック	(株)菱光社
黒崎播磨(株)	日本電産トーソク(株)	レニショー(株)
黒田精工(株)	(株)ノビテック	

(順不同)

【光計測シンポジウム 2011】

日程 10月14日(金)10:00-16:10
会場 東京ビッグサイト 会議棟 605 室
主催 日本光学測定機工業会
参加費 5,000 円(論文集代を含む)

講演題目/発表者(*登壇者) 内容は予告なく変更される場合があります。

時間	【座長】 佐々木修己(新潟大学)
10:00～10:20	産業用ポータブル OCT スキャナーの技術展開 (千葉大学) * 椎名達雄
10:20～10:40	柱状物の2点間距離の精密な光散乱計測法 (筑波大学) * 星野鉄哉、谷田貝豊彦、伊藤雅英
10:40～11:00	パイプ内面のキズ検査 (埼玉医科大学) * 吉澤 徹
	【座長】 藤本洋久(オリンパス(株))
11:10～11:30	波面差分データからの波面導出演算法と鏡面形状計測 (新潟大学) * 佐々木修己、渡辺旭宏、鈴木孝昌
11:30～11:50	三次元スキャナによる手術ナビゲーター (パルステック工業(株)) * 高井利久
11:50～12:10	縞パターンの投影による半透明体の濁度測定法 (木更津工業高等専門学校) * 小田 功 (北海道立工業技術センター) 菅原智明、吉岡武也
	【座長】 明田川正人(長岡技術科学大学)
13:00～13:20	あらゆる環境下での確信ある干渉計の追究 (キヤノンマーケティングジャパン(株)) * 鈴木秀和
13:20～13:40	白色光干渉計搭載型画像測定機 'QUICK VISION WLI' シリーズ (株)ミツヨ) * 本橋 研、浅野 秀光、長濱 龍也、井村 隆治、石山 拓
13:40～14:00	リアルタイム3波長ワンショット干渉計測法の開発 (東レエンジニアリング(株)) * 小林 央、北川 克一
14:00～14:20	非接触マルチセンサ 3D 計測システム HN-6060 の開発 (株)ニコン) * 清水房生
14:20～14:40	多関節型三次元測定機による光学非接触測定 (株)小坂研究所) * 江原史和、古橋圭介
	【座長】 有賀 亨(キヤノン(株))
14:50～15:10	LED 計測管理紹介 (株)トプコン) * 春原広明、友松秀和、鶴岡政義、井崎雄三
15:10～15:30	位相子と検光子の二重回転型分光ストークス偏光計 (宇都宮大学) * 水谷亮太、大谷幸利
15:30～15:50	周波数標準を用いた光共振器絶対光学長測定 (長岡技術科学大学) * 明田川正人、村井慶之介
15:50～16:10	波長走査干渉計による石英ガラス平板の厚さ測定 (独立行政法人産業技術総合研究所) * 日比野 謙一、近藤 余範、金 亮鎮

【併催企画（参加無料）】

・実務応用セミナー

10月13日(木)	11:00-11:45	(株)トプコンテクノハウス
10月13日(木)	13:00-13:45	ボリュームグラフィックス(株)
10月13日(木)	14:00-14:45	(株)ニコンインステック
10月13日(木)	15:00-15:45	(株)ミットヨ
10月14日(金)	11:00-11:45	(株)ベイビッグ
10月14日(金)	13:00-13:45	トリモス・シルバック ジャパン(株)
10月14日(金)	14:00-14:45	中央精機(株)
10月14日(金)	15:00-15:45	(株)ミットヨ

・新技術発表コーナー

宇都宮大学オプティクス教育研究センターにおける偏光計測技術の紹介	宇都宮大学オプティクス教育研究センター
光応用新技術の紹介および実用化を目指している新規的なイカの鮮度評価法の紹介	木更津工業高等専門学校 / 北海道立工業技術センター
角度の超高精度計測を実現する自己校正機能付きロータリエンコーダ	(独)産業技術総合研究所
光学式内径および内面形状計測装置	NPO 三次元工学会 / 埼玉医科大学
ポータブルOCTスキャナー / 超小型LEDライダーの産業展開	千葉大学大学院融合科学研究科 椎名研究室
軸受運動誤差測定装置 / 超音波振動を利用した各種薄板の非破壊搬送装置	長岡技術科学大学 精密加工機構計測研究室

・技術相談コーナー

近年、成形加工技術などの高度化に伴い加工物が複雑になると共に測定機も多様化しており、専門技術者でも困る場合があります。当展示会では、会場内に専門技術者による技術相談コーナーを開設し、ご相談を秘密厳守でお受けします。

【同時期開催展示会】

下記関連展示会との同時開催により、関連応用分野からも多数の来場者が訪れます。

センサエキスポジャパン 2011

[併催] センサネットワーク+位置情報システム EXPO2011

主催：フジサンケイビジネスアイ 特別協賛：次世代センサ協議会

TEST2011 [第11回総合試験機器展]

主催：日本試験機工業会

国際セラミックス総合展 2011

主催：社団法人日本セラミックス協会、財団法人ファインセラミックスセンター、
社団法人日本ファインセラミックス協会、フジサンケイ ビジネスアイ

詳細はホームページをご覧ください <http://www.mt-expo.jp>